

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局

(43) 国际公布日
2023 年 6 月 29 日 (29.06.2023)



(10) 国际公布号
WO 2023/116158 A1

(51) 国际专利分类号:

F16K 3/02 (2006.01) *F16B 5/02* (2006.01)
F16K 27/04 (2006.01) *F16B 5/06* (2006.01)
F16K 27/08 (2006.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2022/126480

(22) 国际申请日: 2022 年 10 月 20 日 (20.10.2022)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:
202111564625.7 2021 年 12 月 20 日 (20.12.2021) CN

(71) 申请人: 拓荆科技股份有限公司 (PIOTECH INC.) [CN/CN]; 中国辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号, Liaoning 110171 (CN)。

(72) 发明人: 宋宇 (SONG, Yu); 中国辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号, Liaoning 110171 (CN)。
谈太德 (TAN, Taide); 中国辽宁省沈阳市浑

南区水家 900 号, Liaoning 110171 (CN)。 姜巍 (JIANG, Wei); 中国辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号, Liaoning 110171 (CN)。

(74) 代理人: 北京律盟知识产权代理有限公司 (LEE AND LI - LEAVEN IPR AGENCY LTD.); 中国北京市东城区建国门南大街 7 号北京璞邸酒店 A 座 2202 室, Beijing 100005 (CN)。

(81) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。

(54) Title: GATE VALVE FOR SEMICONDUCTOR APPARATUS, AND MAINTENANCE METHOD THEREFOR

(54) 发明名称: 用于半导体设备的门阀及其维护方法

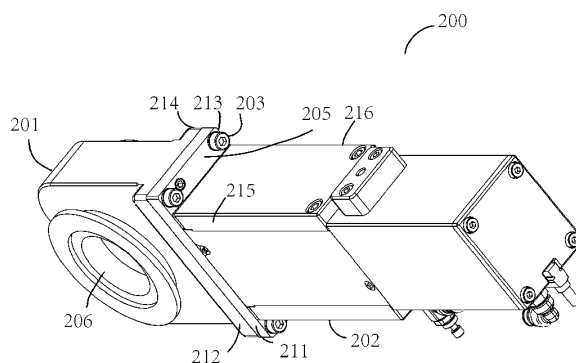


图3

(57) Abstract: A gate valve (200) for a semiconductor apparatus, and a maintenance method therefor. The gate valve (200) comprises: a valve box (201), which has a passage (206) for being connected to a vacuum pipeline in a semiconductor apparatus; an actuation mechanism (202), which has a connecting flange (205) for being connected to the valve box (201); and a fixing device, which is arranged on the connecting flange (205) and is configured to detachably connect the actuation mechanism (202) to the valve box (201), wherein the removal direction of the fixing device is in the direction of the actuation mechanism (202).

(57) 摘要: 用于半导体设备的门阀 (200) 及其维护方法。门阀 (200) 包括: 阀盒 (201), 其具有用于连接半导体设备中的真空管路的通道 (206); 执行机构 (202), 其具有用于连接阀盒 (201) 的连接法兰 (205); 以及固定装置, 其设置于连接法兰 (205) 上且经配置以将执行机构 (202) 可拆卸地连接至阀盒 (201), 其中固定装置的拆卸方向朝向执行机构 (202)。

[见续页]

WO 2023/116158 A1

(84) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:

— 包括国际检索报告 (条约第21条(3))。